

Judul:

Glow discharge processes: sputtering and plasma etching / Brian Chapman

Pengarang/Penulis:

Chapman, Brian

Subjek:

Sputtering (Physics); Glow Discharges

Nomor Panggil:

[537.52 CHA g;537.52 CHA g (2), 537.52 CHA g (2)]

Penerbitan:

John Wiley & Sons

Link Terkait:

- [Deskripsi Bibliografi](#)
- [Dokumen Yang Mirip](#)
- [Universitas Indonesia Library](#)